# 04,08

# Аномально узкий спектр локализованных состояний в аморфном нитриде кремния

© Ю.Н. Новиков<sup>1</sup>, В.А. Гриценко<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск, Россия <sup>2</sup> Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия E-mail: nov@isp.nsc.ru

Поступила в Редакцию 2 августа 2024 г. В окончательной редакции 13 сентября 2024 г. Принята к публикаци: 17 сентября 2024 г.

Методом термостимулированной деполяризации установлен энергетический спектр локализованных дырочных состояний в аморфном нитриде кремния  $(Si_3N_4)$ . Энергия дырочной ловушки составляет величину 1.15 eV. Ширина спектра дырочных локализованных состояний не превышает 10 meV, что меньше kT = 26 meV при комнатной температуре. Этот результат указывает на то, что уширение уровня локализованных состояний, за счет отсутствия дальнего порядка в аморфном Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, т. е за счет флуктуаций межатомного расстояния Si-N, тетраэдрического угла N-Si-N и диэдрического угла Si-N-Si, мало.

Ключевые слова: термостимулированная деполяризация, нитрид кремния, ловушки, многофононная ионизация.

DOI: 10.61011/FTT.2024.10.59077.207

# 1. Введение

Аморфные полупроводники и диэлектрики характеризуются отсутствием дальнего порядка в расположении атомов и наличием локализованных состояний (ловушек) [1,2]. Отсутствие дальнего порядка в аморфных полупроводниках и диэлектриках может вызывать флуктуации потенциала, приводящие к уширению дискретных уровней [1,3]. Типичным диэлектриком с высокой  $(10^{18} - 10^{21} \, \text{cm}^{-3})$  концентрацией ловушек и широкой (4.5 eV) запрещенной зоной является аморфный нитрид кремния (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>) [4,5]. Перенос и локализация электронов и дырок на ловушках в Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> лежит в основе принципа действия современной флэш-памяти нового поколения [6], а также мемристоров [7–10]. В настоящее время, аморфный Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> является модельным материалом при изучении процессов локализации и транспорта заряда в диэлектриках [11-21]. Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> является тетраэдрическим соединением, в котором атом Si координирован четырьмя атомами N, а атом N координирован тремя атомами Si [4]. В Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> имеют место флуктуации межатомного расстояния Si-N, тетраэдрического угла N-Si-N и диэдрического угла Si-N-Si [17,18]. Установлено, что в качестве ловушки, ответственной за локализацию электронов и дырок в Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, выступает дефект — Si-Si связь [12,13,15]. Флуктуации межатомного расстояния, тетраэдрического и диэдрического угла могут приводить к уширению энергетического спектра ловушек в Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. На рис. 1 приведены спектры локализованных состояний для электронов и дырок в Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> по данным разных работ [19-21]. Литературные данные по спектру

электронных и дырочных ловушек в Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> качественно можно разделить на три группы (рис. 1): 1) дискретный спектр (a) [19]; уширенные гауссовы спектры (b) [20]; 3) непрерывные широкие спектры (c) [21]. Метод термостимулированной деполяризации (ТСД) является эффективным методом спектроскопии локализованных состояний в полупроводниках и диэлектриках [22–24].

Целью настоящей работы является установление характера спектра дырочных ловушек в  $Si_3N_4$  методом ТСД.

# 2. Эксперимент и методика расчета

Исследовались структуры Al-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> (40 nm)-SiO<sub>2</sub> (2 nm) — Si (*p*-типа,  $\rho \approx 10$  Ohm · cm). Аморфный нитрид кремния получен при 800°C пиролизом смеси SiCl<sub>4</sub>+NH<sub>3</sub>. Соотношение SiCl<sub>4</sub>/NH<sub>3</sub> составляло 1/10. Поляризация Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> дырками осуществлялась при отрицательном потенциале на Al. Величина захваченного заряда контролировалась путем измерения напряжение плоских зон ( $U_{FB}$ ), которое, в конце зарядки структуры, составило 3.1 V. Деполяризация происходила при небольшом положительном потенциале (4 V) на Al при линейно возрастающей температуре со скоростью 1 K/s. Дырочный ток деполяризации регистрировался вовремя нагрева структуры от 300 K до 650 K.

Для теоретического описания переноса заряда используется одномерная однозонная модель (инжекция и перенос электронов пренебрегаются). Неоднородное электрическое поле в Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> рассчитывается с помощью уравнения Пуассона. В работе рассмотрены три модели 
 Е<sub>v</sub>
 1.01

 Рис. 1. Энергетический спектр локализованных состояний для электронов и дырок в аморфном Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> по данным разных работ. Цифры внутри рисунка обозначают значения энергии

ловушек, взятые из работ: a - [19], b - [20], c - [21].

2.3 2.2 b

1.1 eV

c

2.8

2.0

1.8

2.8

a

1.52

энергетического спектра ловушек: *I* — дискретный уровень ловушки, *2* — непрерывный спектр ловушек с тремя разными уровнями энергии и одинаковой концентрацией, *3* — гауссово распределение ловушек. Для описания переноса заряда в Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> использовались следующие уравнения:

$$\frac{\partial p(x,t)}{\partial t} = \frac{1}{e} \frac{\partial j(x,t)}{\partial x} - \sum_{i} \sigma v p(x,t) \left( N_{i} - p_{i}^{t}(x,t) \right) + \sum_{i} p_{i}^{t}(x,t) P_{i}(x,t),$$
(1)

$$\frac{\partial p_i^t(x,t)}{\partial t} = \sigma v p(x,t) (N_i(x,t) - p_i^t(x,t)) - p_i^t(x,t) P_i(x,t)$$
(2)

$$\frac{\partial F(x,t)}{\partial x} = -\frac{\partial^2 U(x,t)}{\partial x^2} = e \frac{p(x,t) + \sum_i p_i^i(x,t)}{\varepsilon \varepsilon_0}, \quad (3)$$

где индекс i = a, b, c в зависимости от числа энергетических уровней ловушек,  $P_i$  — вероятность ионизации ловушки при заданных значениях электрического поля (F) и температура (T), U — электрический потенциал,  $\sigma$  — сечение захвата,  $N_i$  — концентрация ловушек, p и  $p_t$  — концентрация свободных и захваченных дырок, e — заряд электрона,  $v = 10^7$  cm/s — скорость дрейфа дырок [25],  $\varepsilon = 7.0$  — низкочастотная диэлектрическая проницаемость Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. Скорость дрейфа дырок связана с плотностью тока соотношением j = epv.

Для описания переноса заряда используется модель многофононной ионизации ловушек [26]. В рамках этой модели вероятность ионизации ловушки описывается выражением:

$$P = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \exp\left[\frac{nW_{ph}}{2kT} - S \coth\frac{W_{ph}}{2kT}\right] I_n$$
$$\times \left(\frac{S}{\sin h(W_{ph}/2kT)}\right) P_i^{tun}(W_t + nW_{ph}), \qquad (4)$$

$$P_i^{tun}(W_{tun}) = \frac{eF}{2\sqrt{2m^*W_{tun}}} \exp\left(-\frac{4}{3}\frac{\sqrt{2m^*}}{\hbar eF}W_{tun}^{3/2}\right),$$
$$S = \frac{W_{OPT} - W_T}{W_{oh}},$$

где  $W_T$  — термическая и  $W_{OPT}$  — оптическая энергии ионизации ловушек,  $W_{tun}$  — энергия туннелирования носителей,  $W_{ph}$  — энергия фононов, k — постоянная Больцмана,  $I_n$  — функция Бесселя,  $m^*$  — эффективная туннелирующая масса. В качестве граничного условия для уравнения (3) используется величина импульса внешнего напряжения U, приложенного к Al-контакту. При поляризации инжекционный ток дырок из Si-подложки рассчитывается на основе механизма Фаулера–Нордгейма.

# 3. Сравнение эксперимента с расчетом

#### 3.1. Ловушка с дискретным уровнем энергии

Рассматривается ловушка с дискретным уровнем энергии  $W_T$  и концентрацией  $N_0$  рис. 2, *a*. На рис. 2, *b* показана зависимость тока деполяризации от температуры.



**Рис.** 2. *а* — Модель дискретного уровня ловушки с энергией  $W_T$  и концентрацией  $N_0$  в Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, *b* — зависимость тока деполяризации от температуры при положительном напряжени 4 В на Al. Квадраты — эксперимент, пунктирная линия расчет для дискретного уровня с энергией  $W_T = 1.15$  eV.

 $E_c$ 

= 4.6 eV

Ы

M

Наблюдается удовлетворительное согласие эксперимента и теории. Из наилучшего согласия эксперимента и расчета получены следующие параметры дырочных ловушек:  $W_T = 1.15 \text{ eV}$ ,  $W_{OPT} = 2.3 \text{ eV}$ ,  $W_{ph} = 0.06 \text{ eV}$ ,  $N_0 = 4 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ ,  $\sigma = 5 \cdot 10^{-14} \text{ cm}^2$ ,  $m^*/m_e = 0.5$ ,  $m_e$  — масса свободного электрона. Полученная величина энергии ловушки  $W_T = 1.15 \text{ eV}$  близка по величине к энергии ловушки  $1.01 \pm 0.03 \text{ eV}$ , определенной в работе [19].

# 3.2. Непрерывный спектр ловушек с тремя разными уровнями энергии и одинаковой концентрацией

На рис. 3, а представлена модель непрерывного спектра ловушек с тремя разными уровнями энергии  $W_T^a$ ,  $W_T^b = W_T$  и  $W_T^c$ , с  $W_T^b - W_T^a = W_T^c - W_T^b$ , где  $W_T^b = 1.15 \text{ eV}$ , и одинаковой концентрацией  $N_1 = N_2$ =  $N_3 = N_0 = 4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ ; b — ТСД Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> (эксперимент — квадраты) и расчет (сплошная линия) для трех различных значений  $\Delta W$ : 0.01, 0.1, 0.5 eV.

На рис. 3 видно, что увеличение числа энергетических уровней для ловушек не приводит к улучшению согласия с экспериментом. Для разных значений  $\Delta W$  расчет



**Рис. 3.** a — модель непрерывного спектра ловушек с тремя разными уровнями энергии и одинаковой концентрацией  $N_0$ ; b — сравнение эксперимента ТСД (I — квадраты) с расчетом (2, 3, 4 — непрерывные линии) для модели непрерывного спектра ловушек с  $W_T^b = 1.15 \text{ eV}$  при напряжении деполяризации 4 V. Значения дисперсии (расстояние между уровнями ловушек  $\Delta W$ ) составляет: 2 — 0.01, 3 — 0.1, 4 — 0.5 eV.



**Рис. 4.** a — модель, при которой концентрации ловушек распределена по закону Гаусса в зависимости от их энергии, b — сравнение эксперимента ТСД (1 — квадраты) с расчетом (2, 3, 4 — непрерывные линии) для гауссовского распределения ловушек c = 1.15 eV при напряжении деполяризации 4 V. Значения дисперсии (расстояние между уровнями ловушек  $\Delta W$ ) составляет: 2 = 0.01, 3 = 0.1, 4 = 0.5 eV.

предсказывает наличие одного пика в спектре ТСД, соответствующего самой глубокой ловушке. Например, для  $\Delta W = 0.5 \text{ eV}$ , самый глубокий уровень будет соответствовать энергии  $W_T^c = 1.15 + 0.5 = 1.65 \text{ eV}$ . Увеличение  $\Delta W$  приводит к смещению единственного пика ТСД в сторону более высоких температур (рис. 3, *b*). Ловушки с небольшой энергией вносят незначительный вклад в спектр ТСД (рис. 3, *b*). Высота пиков ТСД во всех случаях одинакова из-за одинакового количества накопленного заряда ( $U_{FB} = 3.1 \text{ V}$ ), захваченного в ловушках в процессе поляризации структуры.

#### 3.3. Гауссово распределение ловушек

На рис. 4, a представлена модель спектра ловушек с тремя различными уровнями энергии (где i = a, b, c) и концентрацией  $N_i$ , распределенной по закону Гаусса:

$$N_i = N_0 \exp\left(\frac{(W_T^i - W_T)^2}{2\Delta W^2}\right),\tag{5}$$

где  $N_0$  и  $N_i$  — максимальная и рассчитанная концентрация ловушек, соответственно. Для  $\Delta W$  использовались значения 0.01, 0.1, 0.5 eV. На рис. 4, *b* показано сравнение эксперимента ТСД (квадраты) с расчетом (сплошные линии) при концентрации ловушек, рассчитанных по формуле (5) при  $N_0 = 4 \cdot 10^{18}$  cm<sup>-3</sup>, при различных значениях  $\Delta W$ . На рис. 4, *b* видно, что с ростом  $\Delta W$ наблюдается сдвиг зависимостей ТСД в сторону более высоких температур. Основной вклад в спектр ТСД вносят глубокие ловушки с энергией  $W_T^c = 1.65$  eV, хотя концентрация ловушек с энергией  $W_T^c = 1.65$  eV.

Отсутствие вклада ловушек с энергией  $1.15 \, eV$  в спектре ТСД обусловлено тем, что в режиме поляризации  $Si_3N_4$  заполнение дырками мало по сравнению с заполнением ловушек с энергией  $1.65 \, eV$ .

# 4. Обсуждение результатов

Эксперименты ТСД удовлетворительно описываются теорией многофононной ионизации в предположении, что в Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> имеются ловушки с дискретным уровнем  $W_T = 1.15 \,\text{eV}$  (рис. 2, b). Расчет ТСД для случая непрерывного и гауссовского спектра ловушек не приводит к улучшению согласия эксперимента и расчета (рис. 3, b и 4, b). Во всех случаях, при наличии ловушек с разными энергиями в Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> в спектрах ТСД, наблюдался один пик, соответствующий наиболее глубоким ловушкам. Незначительный вклад мелких ловушек в спектр ТСД обусловлен тем, что, в режиме поляризации Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, их заполнение мало по сравнению с заполнением более глубоких ловушек. Разброс в литературе относительно спектра ловушек в Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> (рис. 1) может быть обусловлен двумя причинами: 1) разной технологией синтеза Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>; 2) различными моделями, используемыми для описания ионизации ловушек.

# 5. Заключение

В данной работе экспериментально и теоретически исследована ТСД в  $Si_3N_4$ . Эксперимент удовлетворительно описывается теорией многофононной ионизации дырочных ловушек с дискретным уровнем 1.15 eV. Уширение дискретного уровня ловушки в  $Si_3N_4$ , не превышает 0.01 eV. Расчет ТСД для случая непрерывного и гауссовского спектра ловушек не приводит к улучшению согласия эксперимента и расчета. Для моделирования процессов записи/стирания и хранения заряда, во флэш приборах памяти, на основе эффекта локализации электронов и дырок в  $Si_3N_4$ , оправдано применение модели дискретного спектра ловушек.

#### Финансирование работы

Работа поддержана гос. заданием ИФП СО РАН № FWGW-2021-0003.

#### Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

### Список литературы

- H. Мотт, Э. Дэвис. Электронные процессы в некристаллических веществах / Под ред. Б.Т. Коломийца Мир, М. (1982).
- [2] Аморфные полупроводники. Под ред. М. Бродский Мир, М. (1982). 421 с.
- [3] Б.И. Шкловский, А.Л. Эфрос. Электронные свойства легированных полупроводников, Наука, М. (1979). 416 с.
- [4] В.А. Гриценко. УФН 182, 5, 531 (2012).
- [5] V.A. Gritsenko, E.E. Meerson, Yu.N. Morokov. Phys. Rev. B 57, 4, R 2081 (1997).
- [6] A. Goda. Recent Progress on 3D NAND Flash Technologies, Electronics 10, 24, 3156 (2021).
- [7] Е.С. Горнев, И.В. Матюшкин, И.Ф. Калимова. Электронная техника, Серия 3, Микроэлектроника, 2, 182, 33 (2021).
- [8] С.В. Тихов, О.Н. Горшков, И.Н. Антонов, Д.И. Тетельбаум, А.Н. Михайлов, А.И. Белов, А.И. Морозов, Р. Karakolis, P. Dimitrakis. ФТП 52 (12), 1436 (2018).
- [9] Ф.Ф. Комаров, И.А. Романов, Л.А. Власукова, И.Н. Пархоменко, А.А. Цивако, Н.С. Ковальчук. ЖТФ 91, 1, 139 (2021).
- [10] A.A. Gismatulin, O.M. Orlov, V.A. Gritsenko, V.N. Kruchinin, D.S. Mizginov, G.Ya. Krasnikov. Appl. Phys. Lett. 116, 203502 (2020).
- [11] G. Pacchioni, D. Erbetta. Phys. Rev. B 60, 18, 12617 (1999).
- [12] M. Petersen, Y. Roizin. Appl. Phys. Lett. 89, 5, 053511 (2006).
- [13] M.-E. Grillo, S.D. Elliott. Phys. Rev. B 83, 8, 085208 (2011).
- [14] K. Sonoda, E. Tsukuda, M. Tanizawa, Y. Yamaguchi. J. Appl. Phys. 117, 10, 104501 (2015).
- [15] V.A. Gritsenko, T.V. Perevalov, O.M. Orlov, G.Ya. Krasnikov. Appl. Phys. Lett. **109**, *6*, 06294 (2016).
- [16] Yu.N. Novikov, V.A. Gritsenko. J. Non-Crystal. Solids 582, 121442 (2022).
- [17] J. Stöhr, L. Johansson, I. Lindau, P. Pianetta. Phys. Rev. B 20, 2, 664 (1979).
- [18] В.А. Гриценко. УФН 178, 7, 727 (2008).
- [19] S.-D. Tzeng, S. Gwo. J. Appl. Phys. 100, 2, 023711 (2006).
- [20] E. Lusky, Y. Shacham-Diamand, A. Shappir, I. Bloom, B. Eitan. Appl. Phys. Lett. 85, 4, 669 (2004).
- [21] A. Padovani, L. Larcher, D. Heh, G. Bersuker, V.D. Marca, P. Pavan. Appl. Phys. Lett. 96, 22, 223505 (2010).
- [22] J.G. Simmons, G.W. Taylor. Phys. Rev. B 5, 4, 1619 (1972).
- [23] J. G. Simmons, G. W. Taylor, M. C. Tam. Phys. Rev. B 7, 8, 3714 (1973).
- [24] S.L. Miller, D.M. Fleetwood, P.J. McWhorter. Phys. Rev. Lett. 69, 5, 820 (1992).
- [25] R.C. Hughes. Phys. Rev. Lett. 30, 26, 1333 (1973).
- [26] S.S. Makram-Ebeid, M. Lannoo. Phys. Rev. B 25, 10, 6406 (1982).

Редактор К.В. Емцев